

# ナノ・マイクロスケールの微細加工入門シリーズ

## 装置動画で学ぶリソグラフィ工程

～スピンコート・露光・現像を中心に～

**視聴期間** 2023年7月19日（水）～2023年7月25日（火）

- ◆上記視聴期間内であれば何回でも視聴可能です。
- ◆申込方法、視聴環境については次頁をご確認ください。

**講義時間** 約60分

**受講料** 1,000円

**定員** 20名

半導体・MEMS(センサデバイス)、微小光学素子(マイクロレンズ、回折格子)、マイクロ流路(細胞チップ)などにみられる微細構造の製造工程では、紫外線フォトリソグラフィや、電子線リソグラフィ、ナノインプリントリソグラフィといったナノ～マイクロメートルスケールのパターン形成技術が利用されています。

本オンデマンド配信では、動画を交えて当センターの微細加工設備を用いた実験室レベルでのフォトリソグラフィの工程(レジスト塗布、紫外線露光、現像)を中心に、リソグラフィ技術に関する入門知識を解説します。

事例として、クロム金属膜をウェットエッチングして作る光学回折格子の試作工程を紹介し、理解を深めていただきます。

微細加工技術に携わっている方、これからリソグラフィ技術の知識を深めたいと考えている方、是非ご参加をお待ちしております。

また、9月に「装置動画で学ぶエッチング工程～ウェットエッチング・ドライエッチング～」を配信する予定です。

- ※1 配信動画の著作権は都産技研に帰属します。録音・録画はご遠慮ください。
- ※2 本オンデマンド配信は音声読み上げソフトを使用しています。
- ※3 本オンデマンド配信の内容は、昨年オンデマンド配信した技術セミナー「MEMS 微細加工入門・I リソグラフィ」と同等です。

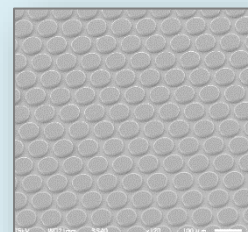
### 講座内容

配信時間	科目	講師
約60分	<p>【講義】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. リソグラフィ技術の概要</li> <li>2. フォトリソグラフィ技術の工程</li> <li>3. その他のリソグラフィ技術 (電子線リソグラフィ・ナノインプリントリソグラフィ)</li> <li>4. 加工事例の紹介</li> </ol>	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 電気技術グループ 宮下 惟人

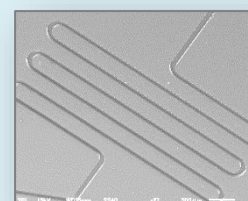


マスコットキャラクター チリン

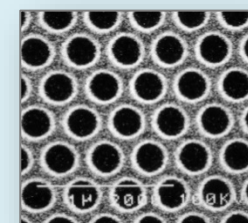
#### <加工パターンの例>



マイクロディ  
スクパターン



マイクロ流路  
パターン



ナノホールパターン

### 募集要項

- 〈応募資格〉 原則として、日本の法人の従業員、個人事業主または創業を予定している個人  
〈申込締切〉 2023年7月5日（水）  
※定員を超えた場合は期日前に締め切ることがあります。  
〈申込方法〉 都産技研ウェブサイト (<https://www.iri-tokyo.jp/seminar/230719.html>) の Web 申込フォームからお申し込みください。



### ●申込時には、

「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター技術支援事業ご利用約款  
第1章 総論および第7章 技術セミナー・講習会オンラインでの開催」  
(<https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/15390.pdf>) の  
条文についてご承諾の上お申し込みをお願いします。



- 〈受講可否〉 受講予定者には受講料払込書を郵送します。  
定員などの関係で受講をお断りする場合は、電話・電子メールなどにてご連絡いたします。

### 参加方法

- 1 受講料の入金確認後、本オンデマンド配信の視聴期間初日までに E メールで視聴 URL およびパスワードを申込者に送付いたします。  
テキストは、E メールまたは郵送にて送付いたします。  
**※受講者以外の第三者が上記ログイン情報を使用することはできません。**  
**また、上記ログイン情報を貸与、譲渡、売買などすることはできません。**
- 2 視聴環境（パソコンなど）は、お客さまにてご用意ください。  
お客様の視聴環境に関する問い合わせには、お答えできません。
- 3 Web ブラウザは、Microsoft® Edge<sup>※1</sup> または Google chrome<sup>TM※2</sup> をご使用ください。  
<sup>※1※2</sup> Microsoft® Edge はマイクロソフト社の登録商標で、Google chrome<sup>TM</sup> はグーグル社の商標です。

### 問い合わせ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術振興室 技術セミナー係  
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308 FAX:03-5530-2318  
メール：[kenshu@iri-tokyo.jp](mailto:kenshu@iri-tokyo.jp)

